

# 製品一覧



業界初！

非接触・非破壊・瞬時測定を初実用化



## ■ Laser Bond Tester I d

<手動測定>

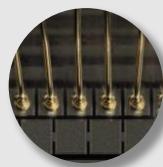
アルミ太径レーザーボンドテスター  
(測定対象 :  $\phi 50\mu m \sim \phi 200\mu m$   
 $\phi 200\mu m \sim \phi 400\mu m$ )



## ■ Laser Bond Tester I

<自動測定>

アルミ太径レーザーボンドテスター  
(測定対象 :  $\phi 50\mu m \sim \phi 200\mu m$   
 $\phi 200\mu m \sim \phi 400\mu m$ )



## ■ Laser Bond Tester II d

<手動測定>

金/銅 細径レーザーボンドテスター  
(測定対象 :  $\phi 15\mu m \sim \phi 40\mu m$ )



## ■ Laser Bond Tester II

<自動測定>

金/銅 細径レーザーボンドテスター  
(測定対象 :  $\phi 15\mu m \sim \phi 40\mu m$ )



## ■ Laser Bond Tester I・II + Magazine Changer

<全自動測定>

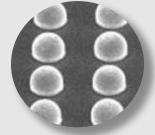
- 金/銅 細径レーザーボンドテスター  
(測定対象 :  $\phi 15\mu m \sim \phi 40\mu m$ )
- アルミ太径レーザーボンドテスター  
(測定対象 :  $\phi 50\mu m \sim \phi 200\mu m$ ,  $\phi 200\mu m \sim \phi 400\mu m$ )



## ■ Laser Bump Tester

<手動または自動測定>

ウエハ金バンプテスター  
(測定対象 :  $\phi 10\mu m \sim \phi 40\mu m$ )



検査対象部位	アルミワイヤボンドの接合面積		金/銅ワイヤボンドの接合面積	金ウエハバンプの接合面積
検査対象	パワー半導体、IGBTなど		メモリIC、ロジックIC、光半導体など	ウエハレベルCSP
ワイヤ径・バンプ径	$\phi 50\mu m \sim \phi 200\mu m$ (細径)	$\phi 200\mu m \sim \phi 400\mu m$ (太径)	$\phi 15\mu m \sim \phi 40\mu m$ (極細径)	$\phi 10\mu m \sim \phi 40\mu m$ (WLCSP)
レーザータイプ	赤外半導体レーザー			青色半導体レーザー
レーザースポット	$\phi 50\mu m$	$\phi 200\mu m$	$\phi 20\mu m$	$\phi 10\mu m$
手動評価装置 (電動ステージ)	Laser Bond Tester I d -SD50M	Laser Bond Tester I d -LD200M	Laser Bond Tester II d -ESD20M	Laser Bump Tester -WB10M
半自動検査装置 (画像位置補正)	Laser Bond Tester I -SD50SA	Laser Bond Tester I -LD200SA	Laser Bond Tester II -ESD20SA	Laser Bump Tester -WB10SA
全自动検査装置 (マガジン供給)	Laser Bond Tester I -SD50A	Laser Bond Tester I -LD200A	Laser Bond Tester II -ESD20A	Laser Bump Tester -WB10A
オンライン検査装置	開発中	開発中	開発中	開発中

2023年1月現在

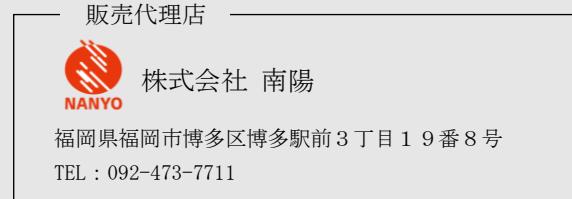
標準納期：仕様詳細ご承認後6か月～

1) 各装置の仕様詳細は、個別カタログを参照してください。

2) 本装置の測定原理は、株式会社ジェイテクトの特許に基づいています。

3) "レーザーボンドテスター"及び"Laser Bond Tester"は、アイエルテクノロジー株式会社の登録商標です。

標準納期：仕様詳細ご承認後9か月～

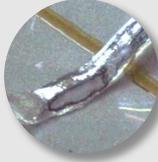


# Products Line-Up for Various Inspection Application



**Industry's  
First**

First practical application of non-contact,  
non-destructive and instantaneous measurement



■ Laser Bond Tester I d

<Manual>

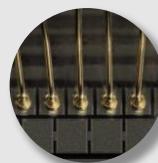
Aluminum Large Diameter Laser Bond Tester  
(Measurement target:  $\phi 50\mu m \sim \phi 200\mu m$   
 $\phi 200\mu m \sim \phi 400\mu m$ )



■ Laser Bond Tester I

< Semi-Auto >

Aluminum Large Diameter Laser Bond Tester  
(Measurement target:  $\phi 50\mu m \sim \phi 200\mu m$   
 $\phi 200\mu m \sim \phi 400\mu m$ )



■ Laser Bond Tester II d

< Manual >

Au/Cu Small Diameter Laser Bond Tester  
(Measurement target:  $\phi 15\mu m \sim \phi 40\mu m$ )



■ Laser Bond Tester II

< Semi-Auto >

Au/Cu Small Diameter Laser Bond Tester  
(Measurement target:  $\phi 15\mu m \sim \phi 40\mu m$ )



■ Laser Bond Tester I + II + Magazine Changer

< Full-auto >

• Au/Cu Small Diameter Laser Bond Tester  
(Measurement target: Au/Cu wire :  $\phi 15\mu m \sim \phi 40\mu m$ )

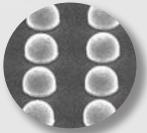
• Aluminum Large Diameter Laser Bond Tester  
(Measurement target:  $\phi 50\mu m \sim \phi 200\mu m$ ,  $\phi 200\mu m \sim \phi 400\mu m$ )



■ Laser Bump Tester

< Manual, Semi-Auto >

Au Bump Laser Bump Tester  
(Measurement target:  
Au Bump :  $\phi 10\mu m \sim \phi 40\mu m$ )



Inspection Target	Aluminum wire bond inner connectivity		Au/Cu wire bond inner connectivity	Au bump inner connectivity
Inspection Product	Power Semiconductor, IGBT		Memory IC, Logic IC Optical Semiconductor	Wafer Level CSP
Wire Dia. Bump Dia.	$\phi 50\mu m \sim \phi 200\mu m$ (Small Dia.)	$\phi 200\mu m \sim \phi 400\mu m$ (Large Dia.)	$\phi 15\mu m \sim \phi 40\mu m$ (Ext. Small Dia.)	$\phi 10\mu m \sim \phi 40\mu m$ (WLCSP)
Laser type	Infrared Semiconductor Laser			Blue Semiconductor Laser
Laser Spot Size	$\phi 50\mu m$	$\phi 200\mu m$	$\phi 20\mu m$	$\phi 10\mu m$
Laser Spot Size	Laser Bond Tester I d -SD50M (Motorized Stage)	Laser Bond Tester I d -LD200M	Laser Bond Tester II d -ESD20M	Laser Bump Tester -WB10M
Semi-Automatic Inspection System	Laser Bond Tester I -SD50SA (Motorized Stage : MS)	Laser Bond Tester I -LD200SA ( MS )	Laser Bond Tester II -ESD20SA ( MS )	Laser Bump Tester -WB10SA ( MS )
Full Automatic Inspection System	Laser Bond Tester I -SD50A (+Magazine Changer : +MC)	Laser Bond Tester I -LD200A ( +MC )	Laser Bond Tester II -ESD20A ( +MC )	Laser Bump Tester -WB10A ( +MC )
In-Line Full- Auto System	Coming Soon	Coming Soon	Coming Soon	Coming Soon

Standard delivery time : 6 months or more after detailed specification approval

As of January 2023

Standard delivery time : 9 months or more after detailed specification approval.

1)Refer to the individual catalogs for detailed specifications of each system.

2)The measurement principle of this system is based on JTEKT Corporation patent.

3)"レーザーボンドテスター" and "Laser Bond Tester" It is a registered trademark of iL Technology Corporation.

**Sales Distributor**



NANYO CORPORATION

Address : 3-19-8, Hakataekimae, Hakata-ku, Fukuoka

TEL : +81(0)92-473-7711

**Manufacturer**

**iL Technology Corporation**

Address : 1-13, 1-chome, Harisaki, Okazaki-shi, Aichi

TEL : +81(0)564-73-2005